04.2;13.1;13.3;15.2 Масс-спектрометрический контроль процесса очистки и дегазации защитных графитовых плиток токамака Глобус-М2

© Н.Н. Аруев, А.Н. Новохацкий, П.А. Романов, Н.В. Сахаров, С.В. Филиппов, П.Б. Щёголев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: aruev.mass@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 17 марта 2023 г. В окончательной редакции 22 мая 2023 г. Принято к публикации 22 мая 2023 г.

> С помощью специально созданного времяпролетного масс-рефлектрона с нагревательным элементом внутри прибора, позволяющим нагревать твердые образцы и анализировать выделяющиеся из них газы, исследованы защитные графитовые плитки, покрывающие практически всю обращенную к плазме поверхность вакуумной камеры токамака Глобус-М2. Масс-спектрометрический анализ позволил определить состав выделяющихся газов, оценить их количества и таким образом количественно охарактеризовать качество очистки и дегазации плиток. Показано, что в результате примененного способа обработки плиток в разы уменьшилось содержание легкого изотопа водорода (протия), воды, окиси и двуокиси углерода, а также практически до нуля снизилось содержание дейтерия и изотопов гелия.

Ключевые слова: защитный графитовый слой, времяпролетный масс-рефлектрон, масс-спектр, токамак.

DOI: 10.21883/PJTF.2023.14.55824.19559

Сферический токамак Глобус-М2 [1,2] представляет собой компактную установку нового поколения (большой радиус 0.36 m, малый 0.24 m, тороидальное магнитное поле ≤ 0.9 T), предназначенную для исследования физических процессов в плазме (с диверторной конфигурацией) и отработки инженерных рекомендаций для сферических токамаков мегаамперного диапазона. Около 98% внутренней поверхности вакуумной камеры токамака Глобус-М2, непосредственно обращенной к плазме, покрыто защитными графитовыми плитками толщиной от 5 до 10 mm, площадью от 100 до 200 cm², всего 614 штук (рис. 1). Защитные плитки изготовлены из графита RGTi, легированного 2 wt.% титана, 0.3–0.7 wt.% кремния и 0.25 wt.% бора [3,4].

Состав и количества сорбированных газов в защитных графитовых плитках после экспозиции в большом числе разрядов дейтериевой плазмы (~ 20 400) исследовались с помощью специально разработанного масс-рефлектрона с линейной траекторией движения ионов [5]. Основным отличием этого прибора от существующих аналогов является наличие в вакуумной камере масс-анализатора нагревательного элемента с термопарой, в который может помещаться кварцевая пробирка с исследуемым образцом. Внутренний диаметр пробирки составляет ~ 2 mm, а высота 10-12 mm. Открытый конец пробирки расположен в непосредственной близости от нижнего края зоны ионизации ионного источника масс-рефлектрона (так, чтобы выделяющиеся при нагреве из образца газы попадали прямо в зону ионизации). Отбор образцов для анализа проводился путем механического снятия тонкого верхнего слоя с поверхности графитовых плиток, взаимодействовавших с плазмой, с помощью острого скальпеля. Полученные графитовые порошки собирались, маркировались и хранились в отдельных контейнерах. Масса образца графита для анализа, помещаемого в кварцевую пробирку, составляла $\sim 1 \text{ mg}$ и взвешивалась на аналитических весах с погрешностью до 0.1 mg. В качестве нагревателя использовалась вольфрамовая нить диаметром 0.3 mm, намотанная на кварцевую трубку. Такая конструкция позволяла нагревать образец от комнатной температуры до 700°C с шагом, например, 100°C.

В соответствии с принятой методикой подобных измерений после достижения вакуума $\sim 1\cdot 10^{-7}$ Torr в камере масс-анализатора производится холостое измерение фонового сигнала, когда в кварцевой пробирке нет образца, т. е. измеряется спектр остаточного газа в приборе при разных температурах. При дальнейшей обработке результатов этот спектр вычитается из получаемых спектров исследуемых образцов при тех же температурах. На рис. 2 приведен "холостой" фоновый спектр пустой кварцевой пробирки при T = 500°C. Это типичный масс-спектр остаточного вакуума любой металлической вакуумной камеры, который содержит атомарный и молекулярный водород: Н⁺, H⁺₂ (пики при 1 и 2 а.т.и.); атомарный углерод ¹²C⁺; метан CH₄⁺; гидроксильную группу и воду OH⁺, H₂O⁺ (16–17–18 а.т.u.); окись углерода CO⁺; азот N₂⁺; этиленподобные органические радикалы $C_2H_4^+$ (неразрешенный пик при 28 а.m.u.); двуокись углерода CO₂⁺ (пик при 44 а.т.u.).

На следующем этапе в нагревательный элемент прибора помещали пробирку с графитовой пробой и осуществляли цикл измерений с регистрацией масс-спектров выделяющихся при нагреве образца газов при разных температурах с шагом 100°С. Необходимо отметить, что при детектировании спектров усреднение идет по 500 точкам, т.е. вместо регистрируемых



Рис. 1. Внутренний вид вакуумной камеры токамака Глобус-М2, облицованной графитовыми плитками. Открытые поверхности — полированная нержавеющая сталь.



Рис. 2. Масс-спектр пустой пробирки при температуре $T = 500^{\circ}$ C.

500 спектров на выходе прибора мы получаем один усредненный спектр.

В результате измерений было обнаружено, что все полученные при различных температурах спектры образцов, взятых с разных защитных графитовых плиток, содержат одни и те же массовые пики, которые различаются только амплитудами, при этом линии фонового спектра по амплитуде в 2-3 раза ниже и в них присутствуют два пика, соответствующих 3 и 4 а.т.и. По нашему мнению, это неразрешенные пики триплета $HHH^+-HD^+-{}^{3}He^+$ и дублета ${}^{4}He^+-{}^{2}D^+$, поскольку легкий изотоп водорода — протий (H⁺, H₂⁺) — всегда есть в любой металлической вакуумной камере, дейтерий (D⁺, D₂⁺) является рабочим газом при проведении плазменных экспериментов, а легкий изотоп ³He⁺ является одним из продуктов термоядерного синтеза с участием дейтерия, и, наконец, тяжелый изотоп гелия ⁴He⁺ используется для чистки тлеющим разрядом вакуумной камеры токамака Глобус-М2, и его незначительные количества могут находиться внутри прибора.

После регистрации масс-спектров графитовых образцов при различных температурах были построены кривые термодесорбции $I_{ion}^+ = f(T[^\circ C])$ практически для всех указанных выше газов. Рассмотрение кривых термодесорбции показало, что ионы, соответствующие пикам с массами 3 и 4 а.т.и., находятся в графитовых образцах не на поверхности твердого вещества, а "вбиваются" плазмой в объем графита, причем при температуре порядка 600-700°С интенсивность этих пиков падает до нуля. Ионы воды, по всей видимости, имеют две фракции: одна располагается на поверхности образца, а другая — глубоко в объеме вещества. Ионы окиси и двуокиси углерода, вероятно, находятся глубоко в объеме графитовых защитных плиток, поскольку на всех кривых десорбции максимальное выделение этих компонентов происходит в высокотемпературной области спектров. Подробнее это описано в работе [6].

Более тщательный анализ большого числа полученных масс-спектров графитовых образцов при разных температурах (порядка 150) и построенных на их основе кривых термодесорбции позволил сделать вывод, что в некоторых случаях необязательно строить кривые $I_{ion}^+ = f(T[^{\circ}C])$. Дело в том, что общий вид масс-спектров, соотношение амплитуд компонентов (например, для изотопов водорода и гелия), величина амплитуд пиков при высоких температурах нагрева образцов дают возможность качественно оценить величины этих компонентов, а также возможность очистки и дегазации защитных графитовых плиток от них. Это подтвердили дальнейшие исследования.

Перечислим основные этапы процесса очистки и дегазации графитовых плиток:

— шлифовка поверхности пластин под проточной водой наждачной бумагой с последовательным уменьшением размера зерна от 50 до $7\,\mu$ m (карбид кремния, SiC);

— первичная промывка пластин дистиллированной водой при температуре 80°С в течение 2 h;

 сушка плиток при атмосферном давлении до полного высыхания;

— очистка плиток в ультразвуковой ванне в среде среднещелочного состава (Кависан-Мульти U) при 50° С в течение 1 h;

— промывка пластин в ванне с барботированием (в дистиллированной воде) в течение 1 h;

— сушка плиток горячим воздухом в течение 1.5 h;

— высокотемпературный отжиг пластин в электровакуумной печи в течение 5 h при 900°C и остаточном давлении $\leq 10^{-7}$ Torr.

Очищенные по такой довольно сложной и трудоемкой методике защитные графитовые плитки были вновь исследованы на наличие в них сорбированных газов. На рис. 3, а представлено сравнение типичных масс-спектров графитового образца с поверхностного слоя плиток, подвергавшихся продолжительному воздействию плазмы в токамаке Глобус-М2 (синяя линия, цветной вариант рисунка представлен в электронной версии

3*



Рис. 3. *а* — масс-спектр графитовой плитки до (синяя линия) и после очистки (красная линия). *b* — увеличенная область масс-спектра графитового образца в диапазоне 0–5 а.т.u. (выделена штрихпунктиром на части *a*). Цветной вариант рисунка представлен в электронной версии статьи.

статьи), и плиток, прошедших обработку по описанной выше методике очистки и дегазации (красная линия). При нагреве неочищенного графита до 500°C амплитуды пиков перечисленных выше основных газовых компонентов превышают амплитуды "холостого" спектра, показанного на рис. 2, более чем в 2 раза. На рис. 3, b в увеличенном масштабе показана область масс-спектра в массовом диапазоне 0-5 a.m.u. при той же температуре. Здесь увеличение амплитуды пика с массой 2 а.m.u. может быть следствием выделения дейтерия D_2^+ , неоднократно вводившегося в камеру токамака. Пики с массами 3 и 4 а.т.u., вероятно, можно идентифицировать как неразрешенные триплет HHH⁺-HD⁺-³He⁺ и дублет ⁴He⁺-D₂⁺ соответственно (синяя линия). Для очищенного образца графита в спектре не наблюдается пиков при 3 и 4 а.т.u., поскольку при отжиге пластин до высоких температур в вакууме дейтерий и гелий десорбировались из графита.

В работе использована комплексная методика очистки и обезгаживания графитовых пластин, применявшихся в качестве защитного материала первой стенки токамака. С помощью масс-спектрометрического анализа газов, выделяющихся при нагреве графитовых образцов, которые отбираются с защитных пластин, мы продемонстрировали эффективность этой методики.

Благодарности

Исследования проведены на УНУ "Сферический токамак Глобус-М", входящей в состав ФЦКП "Материаловедение и диагностика в передовых технологиях".

Финансирование работы

Н.Н. Аруев, П.А. Романов, С.В. Филиппов выполняли масс-спектрометрическую часть работы в рамках государственного задания.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- B.K. Гусев, В.Е. Голант, Е.З. Гусаков, В.В. Дьяченко, М.А. Ирзак, В.Б. Минаев, Е.Е. Мухин, А.Н. Новохацкий, К.А. Подушникова, Г.Т. Раздобарин, Н.В. Сахаров, Е.Н. Трегубова, В.С. Узлов, О.Н. Щербинин, В.А. Беляков, А.А. Кавин, Ю.А. Косцов, Е.Г. Кузьмин, В.Ф. Сойкин, Е.А. Кузнецов, В.А. Ягнов, ЖТФ, 69 (9), 58 (1999). [V.K. Gusev, V.E. Golant, Е.Z. Gusakov, V.V. D'yachenko, M.A. Irzak, V.B. Minaev, E.E. Mukhin, A.N. Novokhatskii, К.А. Podushnikova, G.T. Razdobarin, N.V. Sakharov, E.N. Tregubova, V.S. Uzlov, O.N. Shcherbinin, V.A. Belyakov, A.A. Kavin, Yu.A. Kostsov, E.G. Kuz'min, V.F. Soikin, E.A. Kuznetsov, V.A. Yagnov, Tech. Phys., 44 (9), 1054 (1999). DOI: 10.1134/1.1259469].
- V.B. Minaev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov, V.I. Varfolomeev, [2] N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, E.N. Bondarchuk, P.N. Brunkov, Chernyshev, V.I. Davydenko, V.V. F.V. Dvachenko. A.A. Kavin, S.A. Khitrov, N.A. Khromov, E.O. Kiselev, A.N. Konovalov, V.A. Kornev, G.S. Kurskiev, A.N. Labusov, A.D. Melnik, A.B. Mineev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, M.I. Patrov, Yu.V. Petrov, V.A. Rozhansky, A.N. Saveliev, I.Yu. Senichenkov, P.B. Shchegolev, O.N. Shcherbinin, Sladkomedova, V.V. Solokha, LV. Shikhovtsev, A.D. V.N. Tanchuk, A.Yu. Telnova, V.A. Tokarev, S.Yu. Tolstyakov, E.G. Zhilin, Nucl. Fusion, 57 (6), 066047 (2017). DOI: 10.1088/1741-4326/aa69e0

- [3] T.A. Burtseva, O.K. Chugunov, E.F. Dovguchits, I.V. Mazul, N.N. Shipkov, V.A. Sokolov, M.I. Persin, P.A. Platonov, in *Proc.* 6th Int. Workshop on carbon materials. Binary materials for plasma-facing components (Jülich, Germany, 1993), p. 43.
- [4] A.E. Gorodetsky, A.V. Markin, V.N. Chernikov, A.P. Zakharov, T.A. Burtseva, I.V. Mazul, N.N. Shipkov, G.D. Tolstolutskaya, V.F. Rybalko, Fusion Eng. Des., 43 (2), 129 (1998). DOI: 10.1016/S0920-3796(98)00384-6
- [5] Б.А. Мамырин, Д.В. Шмикк, ЖЭТФ, 76 (5), 1500 (1979).
 [В.А. Mamyrin, D.V. Shmikk, JETP, 49 (5), 762 (1979).].
- [6] Н.Н. Аруев, А.Н. Новохацкий, П.А. Романов, Н.В. Сахаров,
 Р.В. Тюкальцев, С.В. Филиппов, Масс-спектрометрия, 20 (1), 18 (2023).

DOI: 10.25703/MS.2023.20.02.